Also published as:

EP0466979 (A1) WO9201965 (A3)

WO9201965 (A2)

EP0466979 (B1)

Arrangement for simultaneous and confocal picture generation.

Patent number:

DE4023292

Publication date:

1992-01-23

Inventor:

WIJNAENDTS-VAN-RESANDT W ROELO (DE)

Applicant:

LEICA LASERTECHNIK (DE)

Classification:

- international:

G01B11/24; G02B21/00; H04N3/04

- european:

G02B21/00M4A

Application number:

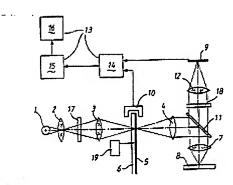
DE19904023292 19900721

Priority number(s):

DE19904023292 19900721

Abstract not available for DE4023292 Abstract of correspondent: **EP0466979**

Arrangement for confocal and simultaneous picture generation with a moving pinhole diaphragm (5) in the illumination ray path with a position-measuring system (10), a raster camera (9) and a processing device (14) for the raster camera, which synchronously reads out the pixels of the pinhole diaphragm. Designed as a microscope and a chromatic surface-profile sensor.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



DEUTSCHES PATENTAMT **® Offenlegungsschrift**

DE 40 23 292 A 1

P 40 23 292.1 Aktenzeichen:

Anmeldetag: 21. 7.90 Offenlegungstag: 23. 1.92

(7) Anmelder:

Leica Lasertechnik GmbH, 6900 Heidelberg, DE

② Erfinder:

Wijnaendts-van-Resandt, W. Roelof, Dr., 7525 Bad Schönborn, DE

(54) Anordnung zur simultanen konfokalen Bilderzeugung

Anordnung zur simultanen konfokalen Bilderzeugung mit bewegter Lochblende im Beleuchtungsstrahlengang mit Lagemeßsystem, mit einer Rasterkamera, und mit synchron die Bildpunkte der Lochblende auslesender Verarbeitungseinrichtung für die Rasterkamera. Ausführung als Mikroskop und als chromatischer Flächen-Profilsensor.

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur simultanen konfokalen Bilderzeugung nach dem Oberbegriff des

Eine solche Anordnung ist aus der DE 38 26 317 C1 und den dort genannten Druckschriften in verschiede-

nen Ausführungen bekannt.

Allen gemeinsam ist, daß je ein bewegtes Lochraster in einer Zwischenbildebene sowohl des Beleuchtungs- 10 als auch des Nachweisstrahlengangs vorgesehen ist, um die Konfokalität zu erreichen. Der Herstellungs- und Justieraufwand ist dadurch beträchtlich. Die Lösung der DE 38 26 317 C1 verringert den Aufwand zwar gegenüber anderen Ausführungen, muß aber dafür eine zeitli- 15 che Modulation des Bildes in Kauf nehmen.

Zur Minderung der Probleme mit den mechanisch bewegten Teilen wird in der DE 38 26 317 C1 die Verwendung optronischer Mittel zur Darstellung der bewegten Lochraster vorgeschlagen, als Nachweissystem 20

ist auch eine CCD-Kamera angegeben.

Aus WO 88/10 406 ist ein simultaner chromatischer Profilsensor bekannt, bei dem jedoch keine Abraste-

rung durch das optische System vorgesehen ist.

Aus WO 88/08 550 (EP-A 3 62 228) ist ein konfokales 25 Laser-Raster-Mikroskop ohne bewegliche Teile bekannt, bei dem bildseitig auf eine bewegte Blende verzichtet wurde und eine Rasterkamera selektiv ausgelesen wird. Dabei wird jedoch stets nur ein Objektpunkt abgetastet. Von der Verwendung von CCD-Arrays und 30 nung, aber selbstverständlich ist die Erfindung auch bei von simultan konfokalen Anordnungen wird in der Schrift ausdrücklich Abstand genommen.

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine gattungsgemäße Anordnung zur simultanen konfokalen Bilderzeugung zu schaffen, die vereinfacht ist und mit möglichst gerin- 35 gen Zusatzeinrichtunen und Eingriffen an konventionelle Einrichtungen zur Bilderzeugung, insbesondere Mi-

kroskope, adaptierbar ist.

Die Lösung dieser Aufgabe gelingt durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1. Vorteilhafte 40 skope entsprechen. Ausgestaltungen und Weiterbildungen sind Gegenstand

der Ansprüche 2 bis 7.

Mit dem Anspruch 2 ist dabei berücksichtigt, daß konfokale Anordnungen besonders für die Mikroskopie zur Erzielung von Überauflösung und zur Selektion von 45 Schärfenebenen in Objekten vorteilhaft sind. Für die berührungslose Profilvermessung unter Nutzung der chromatischen Aberration sind sie ebenfalls vorteilhaft, was in Anspruch 7 berücksichtigt ist.

Die Erfindung geht aus von der Erkenntnis, daß die 50 direkte Beobachtung eines simultanen konfokalen Bildes mit dem Auge in der Praxis wenig Bedeutung hat und darauf verzichtet werden kann. Rasterkamers und Bildanalysesysteme sind dagegen regelmäßig in Ge-

brauch.

Dann kann auf die nachweisseitige optische Lochrasterfilterung verzichtet werden und das von einer Rasterkamera aufgenommene Bild kann durch selektives Auslesen oder Verarbeiten einzelner Pixel elektronisch oder softwaremäßig mit einem Lochraster gefiltert wer- 60

Zur Synchronisierung der Abtastung mit der punktweisen Beleuchtung ist dann eine Messung der Lage des Beleuchtungs-Lochrasters erforderlich, was aber in den Antrieb des Lochrasters integrierbar ist.

Die Erfindung wird anhand der Zeichnung näher dar-

Eine Lichtquelle 1, z. B. eine Glühlampe, Bogenlampe

oder ein Laser, wird über eine Beleuchtungsoptik (2, 3, 4) mit einer Zwischenbildebene 5, einen Strahlteiler 11 und ein Objektiv 7 auf ein Objekt 8 abgebildet. In der Zwischenbildebene 5 ist eine Lochrasterblende 6, z. B. eine Nipkow-Scheibe, angeordnet, die durch einen Antrieb 19 in der Zwischenbildebene bewegt wird. In der aus der simultanen konfokalen Mikroskopie bekannten Weise werden so im Objekt simultan viele getrennte Punkte fokussiert beleuchtet und seriell alle Punkte gescannt. Der Antrieb 19 ist bei Verwendung einer Nipkow-Scheibe 6 als Drehantrieb ausgelegt, an dessen Drehzahlstabilität keine besondere Anforderungen zu stellen sind. Kompaktere Ausführungen von Lochrasterblende 6 und Antrieb 19 ergeben sich mit oszillierenden Antrieben 19 oder mit in elekrooptischen Arrays vereinigten Funktionselementen für Lochrasterung und Bewegung.

Typischer Lochdurchmesser der Lochrasterblende 6 ist 20 µm, der Lochabstand etwa das achtfache und also der Transmissionsgrad etwa 5%. Ein oszillierender Antrieb 19 benötigt dann nur eine Amplitude kleiner als 1 mm und die Lochrasterblende 6 ist praktisch so groß im Querschnitt, wie die anderen optischen Elemente 2, 3, 4 im Beleuchtungsstrahlengang. Damit kann die benötigte Zusatzeinrichtung aus Lochrasterblende 6 und Antrieb 19 leicht als austauschbares Modul zum Einsatz in konventionelle Beleuchtungseinrichtungen für Mikro-

skope und dergleichen ausgeführt werden.

Dargestellt in der Zeichnung ist eine Auflichtanordeiner in bekannter Weise daraus abzuleitenden Durch-

lichtanordnung voll anwendbar.

Das von jedem momentan beleuchteten Punkt des Objekts 8 reflektierte oder transmittierte Licht wird über das Objektiv 7, durch den Strahlteiler 11 und eine Feldlinse 12 auf eine Bildebene abgebildet, in der ein rasterförmiger Bilddetektor 9, insbesondere eine CCD-Array-Kamera, angeordnet ist. Die bildseitige optische Anordnung kann vollständig bekannten Fernsehmikro-

Die erfindungsgemäße Besonderheit besteht in der Verarbeitung der Bildsignale jedes Rasterpunktes (Pixels) des Bilddetektors 9 in der Auswertungseinrichtung 13. Die Auswertungseinrichtung 13 enthält einen schnellen Bildprozessor 14, der von der CCD-Array-Kamera 9 nur die Rasterpunkte, welche dem Bild der Lochrasterblende 6, das über das Objekt 8 auf der CCD-Array-Kamera 9 entsteht, entsprechen, ausliest und in einen Puffer-Bildspeicher 15 einliest.

Jeweils nach einer kleinen Rasterbewegung der Lochrasterblende 5 wird dies für etwas danebenliegende Rasterpunkte wiederholt, bis ein komplettes konfokales Bild im Puffer-Bildspeicher 15 angesammelt ist. Bei der Dimensionierung gemäß dem Beispiel mit 5% Transmission ergeben 20 Teilbilder ein komplettes Bild, wofür etwa 1 s benötigt wird. Dieses Bild wird dann einer Ausgabeeinheit 16, die z. B. einen Bildschirm enthält, zuge-

leitet.

Es ist dabei erforderlich, daß der schnelle Bildprozesesor 14 mit der bewegten Lochrasterblende 6 synchronisiert wird, um sicherzustellen, daß die richtigen Rasterpunkte des Bilddetektors 9 ausgelesen werden. Dazu ist ein Positionsdetektor 10 vorgesehen, der die Position der Lochrasterblende 6 auf einen Bruchteil des 65 Lochdurchmessers genau mißt und damit den Bildprozessor 14 steuert.

Inkrementale fotoelektrische Positionsgeber mit Auflösung, Wiederholgenauigkeit und Langzeitstabilität kleiner als 1 µm sind in der Längen- und Winkelmeßtechnik verfügbar. Es kann damit als Maßstabsstruktur ein Ausschnitt des Lochrasters 6 selbst genutzt werden.

Es ist vorteilhaft, den Maßstab der Abbildung von dem Lochraster 6 auf den Bilddetektor 9 so zu wählen, 5 daß das Bild eines Loches mehrere Pixel des Bilddetektors 9 überdeckt. Dann sind Abweichungen der Rasterstruktur zwischen beiden Bauelementen und relative Verdrehungen ohne Auflösungsverlust in ausreichendem Maß tragbar.

Dann kann der Vorteil der erfindungsgemäßen Anordnung voll ausgenutzt werden, daß der Abbildungsstrahlengang nicht bezüglich des Beleuchtungsstrahlengangs genau justiert werden muß, um die gleichen Löcher oder eine dazu kongruente Lochgruppe der glei- 15 chen Lochrasterscheibe zu treffen, wie das bei den meisten bekannten simultan konfokalen Anordnungen nötig ist. Die Auswahl der jeder Position des Lochrasters 6 gemäß dem Signal des Positionsdetektors 10 zugeordneten Pixel des Bilddetektors 9 durch den Bildprozessor 20 14 kann einmalig oder wiederholt durch Eichbilder bekannter Objekte 8 festgelegt und abgespeichert werden, wobei bekannte Verfahren der Kontrastbestimmung und -Maximierung Anwendung finden. Unregelmäßigkeiten und Exemplarstreuungen der Lochraster 6 oder 25 Bilddetektoren 9 in der Serienproduktion können so aufgefangen werden. Zur schnellen Erzielung von Übersichtsbildern des Objekts 8 kann die Pixelselektion durch den Bildprozessor 14 ausgeschaltet werden, und bei einem einzelnen Scan gewinnt man ein lichtstärke- 30 res Bild gewöhnlicher Auflösung ohne Umbauten der Optik und Mechanik.

Durch die konfokale Anordnung tritt grundsätzlich ein hoher Lichtverlust ein. Um dem zu begegnen, kann er CCD-Array-Detektor 9 in bekannter Weise durch 35 einen vorgeschalteten Kanalplattenvervielfacher oder Nahfeldbildverstärker in seiner Empfindlichkeit gesteigert werden.

In der Zeichnung sind im Beleuchtungs- und Abbildungsstrahlengang optische Elemente 17 und 18 darge- 40 stellt, stellvertretend für beliebige Zusatzeinrichtungen in einem Mikroskop, wie z. B. Kantenfilter für die Fluoreszenzmikroskopie.

Die Ausführung der erfindungsgemäßen Anordnung ist nicht auf die Mikroskopie beschränkt. Hat das Objektiv 7 eine hohe chromatische Aberration und verwendet man eine Farbkamera als Bilddetektor 9, so erhält man einen Flächen-Profilsensor in Weiterbildung der aus WO 88/10 406 vorbekannten Anordnung.

Patentansprüche

1. Anordnung zur simultanen konfokalen Bilderzeugung mit einer Beleuchtungsanordnung (1-4), mit einer Zwischenbildebene (5), einem bewegten 55 Lochraster (6) in der Zwischenbildebene (5), einem Objektiv (7), einem Objekt (8) und einem Detektor (9), dadurch gekennzeichnet, daß der Detektor (9) ein rasterförmiger Bilddetektor ist, ein Lagemeßsystem (10) für die Lage des bewegten Lochrasters (6) 60 vorgesehen ist, zwischen Objekt (7) und Detektor (9) kein Lochraster im Nachweisstrahlengang (7, 11, 12) liegt, und eine Einrichtung (13) zur selektiven Detektorsignalauswertung vorgesehen ist, die gesteuert durch das Lagemeßsystem (10) jeweils nur 65 die Bildsignale des Detektors (9) an den dem Bild des Lochrasters (6) auf dem Detektor (9) entsprechenden Stellen auswertet und seriell aus den Bildsignalen zu verschiedener Lage des Lochrasters (6) ein Gesamtbild erzeugt.

2. Anordnung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Ausbildung als Mikroskop.

Anordnung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Verwendung eines CCD-Detektors.

4. Anordnung nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch die Vorschaltung eines Kanalplattenvervielfachers oder Nahfeldbildverstärkers vor den CCD-Detektor.

5. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß jedem Loch des Lochrasters (6) mehrere Pixel des CCD-Detektors (9) zugeordnet sind.

6. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Einrichtung (13) zur selektiven Detektorsignalauswertung einen schnellen Bildprozessor (14) und einen Puffer-Bildspeicher (15) enthält.

7. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Objektiv eine hohe chromatische Aberration aufweist und die Anordnung als Profilsensor verwendet wird.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

4

Nummer: Int. Cl.⁵:

Offenlegungstag:

DE 40 23 232: A1: H 04 N 3/04 23. Januar 1992

